



FELIPE FIGUEROA

PROPIEDAD INTELECTUAL · BIOTECNOLOGÍA

1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-185631- -00003-0000

Fecha: 2014-10-07 15:25:21 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 2

Doctor:

JOSÉ LUIS SALAZAR

Director de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

REFERENCIA: Expediente **14-185631** PATENTES DE INVENCION

ASUNTO: Respuesta a Oficio **12272** (Requerimiento de forma).

Estimado doctor Salazar, reciba un cordial saludo,

FELIPE EDUARDO FIGUEROA CARDOZO, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 140.243 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación de la UNIVERSIDAD DEL VALLE, solicitante de la patente de invención titulada "**DISPOSITIVO PARA DEPÓSITO EN ANGULO OBLICUO DE MATERIALES A ESCALA NANO Y MICROMETRICA MEDIANTE TECNICAS PVD**" radicada en el expediente **14-185631**, dentro del término legal y dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 39 de la Decisión Andina 486 de 2000, procedo a dar respuesta al requerimiento de forma Oficio N° 12272, notificado mediante Fijación en Lista del 30 de septiembre de 2014, motivo por el cual, adjunto al presente documento:

1. Resumen de la solicitud titulada "**DISPOSITIVO PARA DEPÓSITO EN ANGULO OBLICUO DE MATERIALES A ESCALA NANO Y MICROMETRICA MEDIANTE TECNICAS PVD**", radicada en el expediente **14-185631**, el cual consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la referida solicitud de patente.

En estas condiciones, manifiesto la renuncia al término faltante de contestación del requerimiento y, de manera respetuosa, solicito se tramite la publicación de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Atentamente,

FELIPE EDUARDO FIGUEROA CARDOZO

C.C. 16.940.582

T.P. 140.243 C.S. de la J.

2

DISPOSITIVO PARA DEPÓSITO EN ANGULO OBLICUO DE MATERIALES A ESCALA NANO Y MICROMETRICA MEDIANTE TECNICAS PVD

RESUMEN DE LA INVENCION:

La presente solicitud de Patente de Invención se refiere a un dispositivo para controlar el ángulo de crecimiento de un material aportante evaporado sobre la superficie de un sustrato sin necesidad de emplear una maquina que funcione a partir de servo-motores, con el objetivo de depositar materiales en forma de película delgada a un determinado ángulo oblicuo en procesos de recubrimiento de superficies tales como el PVD (Deposición en fase de Vapor, en inglés Vapor Phase Deposition). El Dispositivo se conforma de los siguientes componentes estructurales: Un tubo de diámetro mayor, dos ejes verticales, un eje horizontal, una transmisión de engranajes que se conforma de un engranaje conductor de geometría especial, un engranaje conducido de geometría especial, dos porta-sustratos superior e inferior, una varilla de amarre o sujeción y una lamina de sujeción.